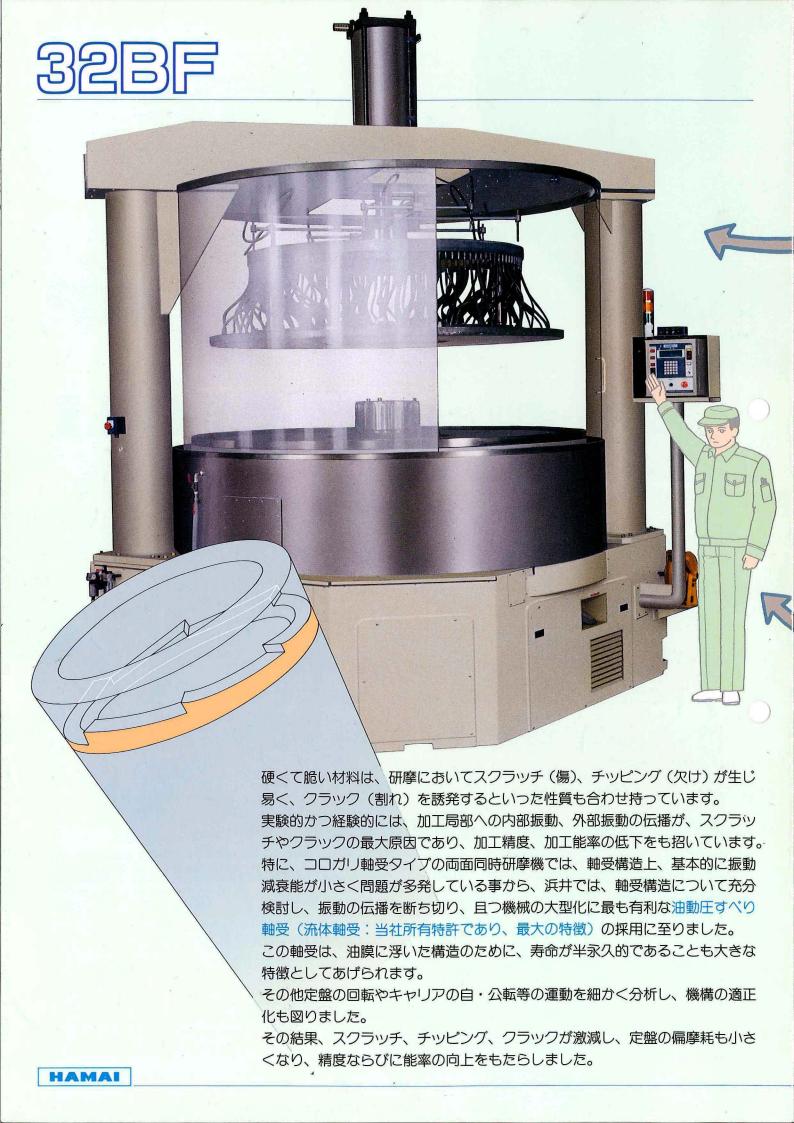


ラップ盤・ポリッシ盤の一人

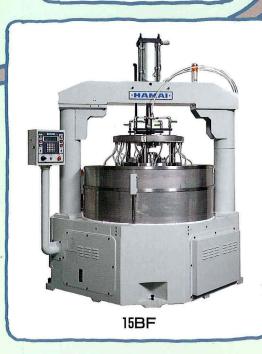
Concept avest

対向して互いに反対の向きに回転する上下定盤と、その間で被加工物を保持しているキャリアの公転と自転などの運動から成るMulti-Way両面同時ラップ盤/ポリッシ盤は、高精度な平行平面が要求される製品の量産加工設備である。



ガラス結晶化ガラス強化ガラス液晶パネルCD、LD原板フォトマスク

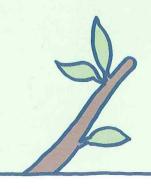
など



半導体シリコンガリウム砒素ガリウム燐など



面面ラップ



その他 サファイア フェライト ガドリウムガリウムガーネット 金属部材

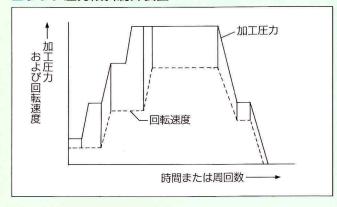
など

振動部品 水晶ジルコンチタン酸鉛チタン酸鉛ニオブ酸リチウムタンタル酸リチウムなど



特徴ある技術要素

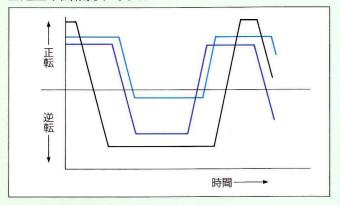
■ラップ圧力傾斜制御装置



形状・材質に合わせてラップ圧力をCPUにより多段階制御し、前加工の歪をなくし、クラック・チッピングを防ぎます。

時間制御方式と回転制御方式いずれも選択可能で、圧力と回転速度が同時に制御できます。

■定盤平面維持サイクル



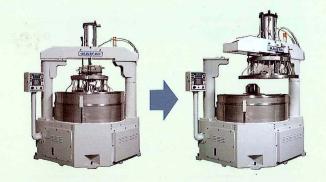
加工しながら、ギヤの回転比率を定時的に変化させる ことができます。

キャリアの正転・逆転を交互に繰り返しながら、修正 キャリアによる修正なしに、極めて長時間にわたって 連続的なラップ作業を行なうことができます。

- ■プログラムコントロールには、お客様の特徴あるノウハウが 8 種類(20ステップ)盛り込めます。
- ■駆動歯車は、すべて焼入れ研摩が施してあります。
- ■ALC定寸装置接続用コネクターおよび回路は標準装備です。(水晶用)
- ■インターナルギヤの自動昇降装置が標準装備です。薄物ワークの取り出し、あるいは加工用キャリア・修正キャリアの出し入れが容易です。
- ■スタート・ストップ時のワークへの衝撃を軽減するため、ソフトスタート・ソフトストップ機能を有します。

■旋回式アーム

定盤交換・クロスの張り替え等に便利です。



■開発・テスト室

ラップ・ポリッシ技術の開発およびお客様のテストのため 「開発・テスト室」を設けております。

小物ワークテスト用の第 1 テスト室(写真)には3BF~9 BF、大物ワークテスト用の第 2 テスト室には15BF~28 BFが常設されています。



ットなど

など

主要諸元

型式:仕様	項目	最大加工物径	加工最少厚 mm·inch	キャリア仕様	上定盤 外径×内径×厚さ mm	下定盤 回転数 rpm	主電動機 (インバータ制御) kW	機械寸法 幅×奥行×高さ mm	機械重量 kg
3BF	1M8L 1M8P	43	0.03(\phi 10)	DP12×Z32	263.4×176.8×20 272×168×20	0~60	0.75	490×490×1,850	200
4 BF	1M5L 1M5P	70	0.04(\phi 10)	M2×Z50×α14.5°	263×117×20	0~60	0.75	490×490×1,850	200
5BF	1M8L 1M8P	80	0.05(ϕ 10)	DP12×Z50	389×213×24	0~60	0.75	550×550×2,000	300
6BF ₂	2M5L 2M5P	105	0.06(<i>φ</i> 10)	DP12×Z66	362×172×24 382.7×150.7×24	0~45	0.75	800×600×1,700	600
6BF ₂ -4B	2M8L 2M8P	70	0.04(\phi 10)	M2×Z50×α14.5°	365×219×24	0~45	0.75	800×600×1,700	600
9BF	2M5L 2M5P	180	0.09(ϕ 15)	DP12×Z108	597×224×35 597×224×25	0~30	2.2	1,420×1,130×2,590	1,400
9BF-6B	2 M 10 L 2 M 10 P	110	0.06(\phi 10)	DP12×Z66	616×384×35 619.5×379.5×20	0~30	2.2	1,420×1,130×2,590	1,400
13BF-9B	2M9L 2M9P	180	0.09(ϕ 15)	DP12×Z108	924×524×40	0~40	5.5	1,630×1,250×2,496	3,000
16BF	2M5L 2M5P	335	0.25(\$\phi\$ 2.5")	DP12×Z200	1,127×397×50 1,157×367×50	0~70	11.0	1,890×1,410×3,110	6,500
18BF	4M5L 4M5P	390	0.3	M3×Z150	1,240×440×50	0~70	11.0×2	1,750×2,485×2,895	8,000
22BF	4M5L 4M5P	470	0.5	M3×Z184	1,458×498×50 1,488×468×50	0~60	11.0×2 15.0×2	2,200×2,760×2,900	10,000
24BF	4M5L 4M5P	550	0.6	M4×Z152	1,572×572×60 1,632×512×60	0~60	11.0×2 15.0×2	2,200×2,760×3,000	12,000
28BF	2M5L 2M5P	660	0.7(φ8")	M4×Z178×α20°	1,864×672×60 1,934×602×70	0~50 0~40	30.0 37.0	2,800×3,100×3,445	17,000 18,000
32BF	2M5L 2M5P	700	0.9(\$\phi\$ 12")	M5×Z162×α20°	2,120×740×50 2,160×700×60	0~40	30.0 45.0	2,740×3,220×4,030	22,000 24,000
40BF ₄	4M5L 4M5P	810	1.1(□550)	M6×Z170×α20°	2,655×945×70 2,685×915×70	0~40	18.5×2 22.0×2	3,460×3,820×4,300	35,000 38,000

- ・小型機は | モータ・ 2 モータ、大型機は 2 モータ・ 4 モータが 選択できます。
- ・上記以外の機種も製作しております。 営業におたずねください。

標準仕様および特殊仕様

小型	型機	大 3	型機
標準仕様	6. 循環タンク	標準仕様	6.飛散防止カバー
Ⅰ. 撹拌タンク 8ℓ	7. ポール型表示灯	1. ラップ圧力傾斜制御装置	7. ハンドシャワー
2. インターナルギヤ昇降装置		2 . インターナルギヤ昇降装置油圧駆動	8. リングシャワー
3 . 上定盤上昇時自動ロック装置		3. 上定盤上昇時自動ロック装置	9. 作業用踏み台
4. ALC装置対応		4. 上下作動外周カバー	10. リンス電磁弁制御
特殊仕様		特殊仕様	11. 寸動用フットスイッチ
1. ラップ圧力傾斜制御装置		1. 自動定寸装置	12. 上定盤上昇ストローク変更
2 . インターナルギヤ昇降装置エアーハイドロ方式		2. 修正キャリア	13. ポール型表示灯
3. 自動定寸装置	1 5	3. 修正キャリア装塡装置	14. アーム旋回時支え台
4. 修正キャリア	<i>y</i>	4. 循環タンク	15. 上定盤落下防止装置(メカロック式)
5. 自動滴下装置	₹	5. 加圧制御	

・機種により若干異なります。営業にご確認願います。

精密平面ラップ盤 9BF-6B 2M10P 取扱説明書

浜 井 産 業 株 式 会 社

中 1-1. 機械概要

本装置は、

ポリッシ剤供給装置を備え、

ポリッシ剤を連続的に滴下しながら、

中心ギヤー、インターナルギヤー及び上下定盤を所定の回転比率で回転させ、

上下定盤の間に挟まれたワークキャリヤーの中にセットされたワークを、

予め設定されたプログラム通りに加工圧力を変化させ、

両面同時にポリッシ加工をする

4軸駆動(フォーウエイ)遊星歯車方式の精密平面ポリッシ盤である。

薄板状のキャリアの取入れ取り出し、ワークの脱着は人手により行う。

本機は、治具を上下定盤の間で駆動させる為の駆動部と、それを制御する部分に分けられる。

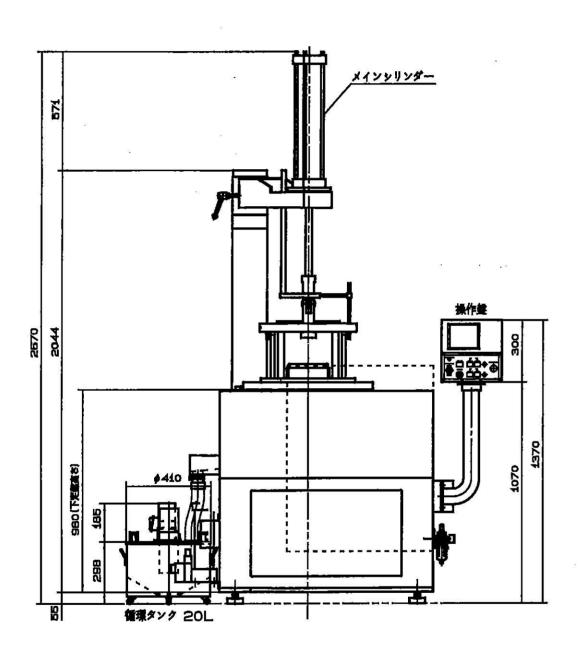


図1-1 9BF 正面図

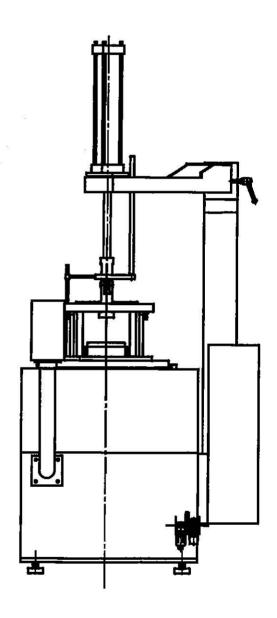


図1-2 9BF 左側面図

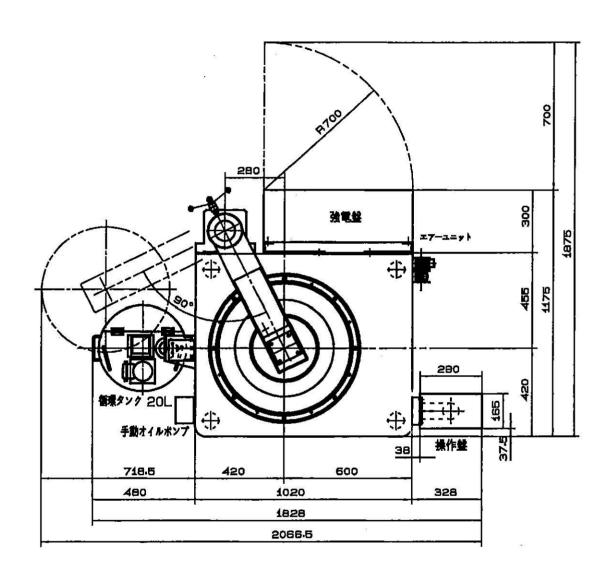


図1-3 9BF 平面図

1-2. 機械 仕様

ポリッシ仕様

0.000	2 3 1-13	58	
(1)	被加工物寸法	(最大径×最小厚み)	.¢105×0.06 (Max. 10 mm)
(2)	上定盤 :	外径×内径×厚み	$.^{\phi}616 \times ^{\phi}384 \times 35^{1}$ mm
		材 質	.SUS304
		穴個数	.16個
(3)	下定盤 :	外径×内径×厚み	. ⁶ 616× 6384×35 tmm
		材 質	.SUS304
(4)	上定盤昇降量		.400 mm
(5)	上定盤上昇端	自動ロック装置	.有
(6)	下定盤回転数		.3~30 min-1 (無段階)
(7)	スロースター	ト/ストップ機能	.有
(8)	インターナル	ギヤ昇降量	.30 mm
(9)	ラップ圧力制	卸方法	.CPU傾斜圧力制御
(10)	ワークキャリ・	ヤ諸元	.DP12×Z66×20.° α (外径φ143.54mm)
(11)	ワークキャリ	ヤ数	最多 10枚
(12)	分配器材象	質	塩化ビニール樹脂
(13)	ラップ剤供給ス		
	攪拌 歹	⁷ ンク式	SUS20 マズ, コック付
(14)	使用空気」	£	0.49MPa (5kg/cm²)
(15)	機械寸法		横1,420×奥1,175×高2,590mm
(16)	機械重量		1,400 kg
(17)	塗 装 色		標準色
(18)	選択仕様 :	操作盤の位置と廃液ホース取出口	右側と左側
(19)	修正キャリア		材質:BSBM、ペレット付修正キャリア (メタルポント゚#1200)

日 1-3. 電気仕様

(1)	使用電源	. AC200/2	20V 3	⊅ 50/60Hz
(2)	定格容量	. 3. 5KVA		ž
(3)	モータ (2モータ)			
49	主モータ			50/60HZ 4P ・一ター制御)
	副モータ		50000 TO 1600	50/60HZ 4P ・一ター制御)
(4)	撹拌タンク			
	撹拌羽根用モータ	. AC200/2	20V	25W
	ポンプ用モータ	. AC200/2	20V	100W
		172		
(5)	制御回路	AC100V,	DC24V	

1-4. 附属品

1-4-1 標準附属品

(1)	レベリングボルト&レベリングシート1式	
(2)	作業工具	
(3)	静的精度検査表1部	
(4)	機械取扱説明書	
(5)	付属品リスト1式	

1-4-2 特別附属品

項目	内	容	仕 様
CPU傾斜圧力制御	仕	様	加工時間/下定盤回転回数、 荷重 - 回転速度の同時 制御、(三菱タッチパネル式小型操作盤)
インターナルギア昇降	仕	様	エアーハイドロ方式
上ポリッシ定盤	仕	様	φ616×φ384×35t 材質:SUS304 ALC用取付穴(φ6.4、2ヶ所)、ポリッシ供給穴:16ヶ所
下ポリッシ定盤	仕	様	φ616×φ384×35t 材質:MGC 内外周リング付(φ630×φ370)
ALC装置用置き台	仕	様	操作盤上取付
コンセント	仕	様	AC100V、操作盤右側面取付
電源ケーブル	仕	様	一次側コネクター付電源ケーブル2m WF8420K(コネクタータイプ)

分 3-1. 操作盤

操作盤は下図の様になっています。

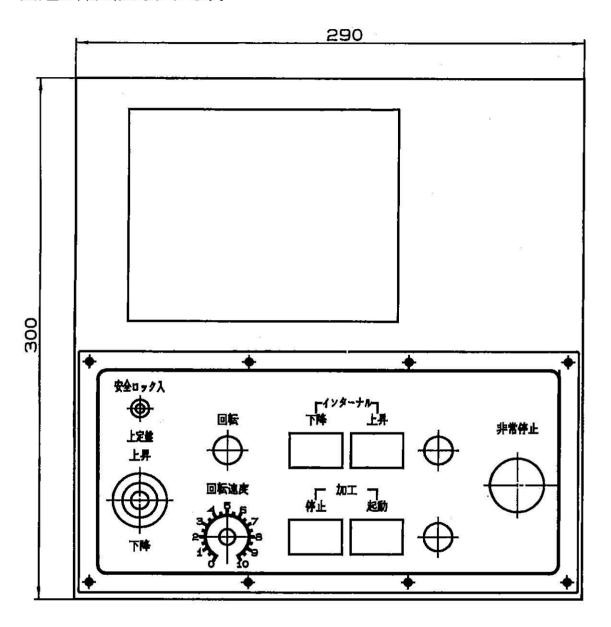


図3-1 操作盤